

センサー・MEMS実践セミナー

文部科学省委託事業「ナノテクノロジープラットフォーム」の一環として、"センサー・MEMS実践セミナー"を開催します。新たに微細加工技術を利用してMEMSデバイスなどを作製したいと考える研究者・技術者や、センサー・MEMSの応用研究に新規参入したいと考える研究者・技術者へのチュートリアル的なセミナー講演と実習を行います。これにより、プラットフォームの積極的利用を促し、研究開発の進展に寄与することを目的とします。多くの皆様の御参加をお待ちしております。

※実習コースのみの参加はできません。

・参加費:無料(実習コースの一部は有料)

・定員:30~40人程度+Web配信

http://nsn.kyoto-u.ac.jp/p/sensor_mems.html

平成28年9月30日(金) 13:00~17:10

会場:東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル 1F セミナー室

※実習コースを開催する機関のうち、北海道大学、東北大学、豊田工業大学、京都大学、広島大学ではWEBによるTV聴講が可能です。東大以外の拠点でTV聴講による参加ご希望の方は、参加申込みの「その他」欄に参加希望の拠点名をお書きください。

講義プログラム

時間	講演題目	講演者
13:00~13:05	開会挨拶	微細加工PF 代表機関
13:05~14:00	基調講演 「センサー・MEMSの最新動向」	田中秀治 先生 東北大学大学院工学研究科
14:00~14:30	特別講演 「IoT市場におけるセンサの技術動向と応用事例」	児堂義一 様 株式会社村田製作所 センサー事業部 事業部長
14:30~15:00	特別講演 「MEMS技術とセンサ応用」	積知範 様 OMRON株式会社 技術知財本部技術専門職
<15分休憩>		
15:15~15:35	最新の成膜技術の紹介 「ALDプロセスに内在する課題」	熊野勝文 先生 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センター
15:35~15:55	最新のエッチャング技術の紹介 「MEMSデバイスにおけるドライエッチャング技術と応用」	内田聰充様 サムコ株式会社
15:55~16:15	最新のリソグラフィ技術の紹介 「デジタル投影によるマスクレス露光技術とその応用」	木村一彦 様 株式会社ナノシステムソリューションズ
16:15~17:00	文科省ナノプラ事業・微細加工PFの紹介 実施機関事例紹介&PR	微細加工PF・コーディネーター 実施機関担当者
17:00~17:10	閉会挨拶&閉会	

基礎実習コース(無料)

①フォトリソグラフィーを用いた樹形電極デバイス作製

電気化学等へ利用可能な樹形電極の作製を通してフォトリソグラフ法の講習を行う。

日程:11月頃、応相談

定員:3名まで

場所:北海道大学(札幌市)

②マイクロ流路作製

マイクロ流路作製に必要な微細加工要素技術を習得するため、マスクレス露光装置を使用したリソグラフィ技術の実習を行う。

日程:応相談

定員:2名

場所:産総研(茨城県つくば市)

③マイクロ流路作製プロセス実習

SU-8によるマイクロ流路作製を行います

日程:応相談

定員:3名程度

場所:東京大学(東京都文京区)

④流路付加バイオセンサーの作製・測定

PDMSマイクロ流路の試作まで

日程:2017年1月初旬

(2日間。有料コースと同時に進行します。)

定員:3名程度

場所:広島大学(東広島市)

アドバンスト実習コース(有料)

⑤グレイスケールリソグラフィ

マイクロレンズなどの3次元形状をCADで設計する。膜厚10μ程度の厚膜レジストを基板に塗布後、レーザ描画装置でグレイスケール露光を行う。現像後の3次元形状を共焦点顕微鏡で観察する。

日程:第一候補:10月20日(木)~21日(金)

第二候補:10月27日(木)~28日(金)

定員:3名程度

場所:東北大学(仙台市)

料金:3万円

尚、参加者の希望にあわせた(持ち込みテーマ)実習もあり

(日程、料金は内容に応じて別途ご相談)

⑥サーモパイプの作製

熱電対、サーモパイプの基本から応用に関する講義、及びデバイス製作と評価を実習する。

日程:2017年3月頃(応相談)

場所:豊田工業大学(名古屋市)

定員:若干名

料金:1または3万円

⑦静電容量型加速度センサーの設計から試作・評価まで

静電容量型加速度センサーに関する講義に加えて、FEM解析を用いた設計から試作・評価までを行う。

日程:2016年11月14日(月)~16日(水) 3日間

定員:4名程度

場所:京都大学(京都市)

料金:2~4万円程度

⑧流路付加バイオセンサーの作製・測定

PDMSマイクロ流路を試作後、MOSFETと組み合わせてセンサーとし、検体模擬水溶液のpHセンシングまで

日程:2017年1月初旬(3日間)

定員:3名

場所:広島大学(東広島市)

料金:1人3万円(予定)

Access Map



お問い合わせはこちら

微細加工プラットフォーム・コーディネーター

TEL: 075-753-5656 Email: nanofab-coordinators@t.kyoto-u.ac.jp

(VDEC提供)